

UNIVERSITÀ DI PISA

DIREZIONE GARE, CONTRATTI E LOGISTICA

Servizio Gare/GT/GA



Direzione Gare, Contratti e Logistica

Il Dirigente

- Vista** la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l'art. 6 "Autonomia delle università";
- Visto** lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive modifiche;
- Vista** la legge 241/1990 e s.m.i. e il regolamento di Ateneo di attuazione della stessa, emanato con D.R. n. 28851 del 15.09.2014;
- Visto** il provvedimento prot. 9961 del 28/02/2017 con il quale il Direttore Generale ha conferito alla Dott.ssa Elena Perini l'incarico di Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 49150 del 22 dicembre 2015;
- Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 << codice dei contratti pubblici>>;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa n. 177 del 10 giugno 2016, sulla quale ha espresso parere favorevole il Senato Accademico dell'Università di Pisa con delibera n.111 del 22 giugno 2016, con la quale è stato stabilito che, nelle more della revisione del Titolo VIII "Attività negoziale" del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, le disposizioni di cui al predetto Titolo VIII del vigente Regolamento e le relative disposizioni attuative continuano ad essere applicate se non in contrasto con le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50;
- VISTA** la delibera protocollo n. 36669 dell'11.06.2018 con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ha delegato la sottoscritta Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica, che, con tale atto ha accettato la delega, all'espletamento delle procedure necessarie per l'acquisto della fornitura di **"RF/DC sputtering per la deposizione di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD)"**;
- VISTA** la medesima delibera protocollo n.36669 dell'11.06.2018 con la quale è stata disposta la pubblicazione sul profilo del committente, per un periodo di almeno 15 giorni, dell'avviso per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex

Lungarno Pacinotti 44 - 56126 Pisa

Il responsabile del Settore: dott. Gabriele Tabacco: _____

La responsabile di P.O.: dott.ssa Giulia Appendino _____

art.36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 della fornitura in parola, per un costo stimato per la fornitura e posa in opera di Euro 82.000,00 oltre I.v.a.;

VISTO: l'Avviso per l'individuazione degli operatori economici per l'acquisizione di forniture e servizi ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016" pubblicato sul sito web/profilo del committente all'indirizzo <https://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/forniture;>

VISTO che la data per la scadenza delle manifestazioni di interesse era fissata per il giorno 28 giugno 2018;

VISTE le manifestazioni di interesse presentate entro il termine indicato nel suddetto avviso;

VISTO che con provvedimento della sottoscritta protocollo n .41295 del 03.07.2018 è stato approvato l'elenco ditte da invitare alla procedura negoziata di cui in premessa;

VISTA la delibera a contrattare, protocollo n.41913 del 05 luglio 2018, con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'acquisizione della fornitura di "**RF/DC sputtering per la deposizione di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD)**" per un importo di Euro 82.000,00 oltre I.v.a. mediante procedura negoziata ex art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 ed è stato approvato il Progetto ai sensi dell'art.23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: lettera invito e documenti allegati;

VISTA la lettera invito protocollo n. 42001 del 05 luglio 2018, inviata agli operatori economici di cui all'elenco approvato sopra detto, mediante START in data 05 luglio 2018;

PRESO ATTO che entro le ore 12,00 del giorno 20 luglio 2018, era fissato il termine per la presentazione telematica delle offerte;

Preso atto che risulta essere pervenuta, entro i termini previsti nelle predette lettere di invito, offerta da parte della ditta 2M STRUMENTI SRL , con sede in Roma, via G. Pontano n. 9, 00141.

Visto il verbale della seduta del seggio di gara del 23 luglio 2018 agli atti della Direzione Gare, Contratti e Logistica, allegato in copia al presente provvedimento, che qui integralmente approvo;

Accertata la regolarità delle operazioni di gara e la legittimità degli atti della procedura di cui alla sopra detta seduta;

Richiamato l' art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

dispongo

- Art. 1) di approvare** il verbale della seduta di gara del 23 luglio 2018 agli atti della Direzione Gare, Contratti e Logistica, allegato in copia al presente provvedimento;
- Art. 2) di approvare l'ammissione** alla procedura di gara per l'affidamento della fornitura di **“RF/DC sputtering per la deposizione di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD)”** la ditta 2M STRUMENTI SRL;
- Art. 3) di ammettere** per i predetti motivi alla procedura di gara in parola il concorrente 2M STRUMENTI SRL;
- Art. 4) di pubblicare** il presente provvedimento, entro due giorni dalla sua adozione, sul profilo di committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall' art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Art. 5) di comunicare mediante PEC**, questo provvedimento alla Società concorrente, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 29, comma 1, punto tre, del D.lgs. n. 50/2016.

Direzione Gare, Contratti e Logistica
La Dirigente - Dott.ssa Elena Perini
(firmato digitalmente)